

SITA

产品表面的清洁度检测

——通过荧光量化的非接触式测量方法



新一代

SITA *CleanoSpector*

清洁度检查 – 膜厚监测

SITA *CleanoSpector*

产品介绍

特点

- 外壳坚固，小巧灵活，可在生产跟实验室环境中任意切换使用
- 操作简便，只需按下按钮即可快速测量
- 额外的传感器触发按钮，实现最佳操控
- 使用间距器直接测量或使用支架非接触测量
- 重复性测量任务可配置独立的应用
- 带扩展型统计特征值的限值监控

多种测量模式

- FluoLevel – 单点测量 RFU 荧光强度模式
- FluoStep – 可设置时间间隔的快速测量模式
- FluoScan – 每秒10次测量的自动扫描模式
- 自定义测量值输出，以清洁度百分比或膜厚度表示



Website with
product video

收益

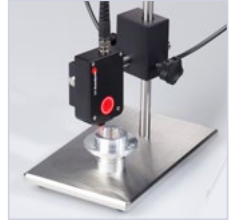
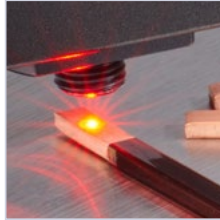
- 快速定期的零件检查，确保产品质量的稳定
- 清洁流程的设计、基准测试和优化
- 有文件记录的质量保证，包括测试协议和测量报告
- 移动测量方式与在线SITA清洁度CI的测量值具有可对比性

附件

- 使用于各种产品的间距器
- 用于检查和校准的校准探头
- 清洁套装和防护罩
- 通过连接条码扫描器进行零件或批次的条码或DMC分配
- 用于非接触式测量，可微调距离并固定部件，便于操作。

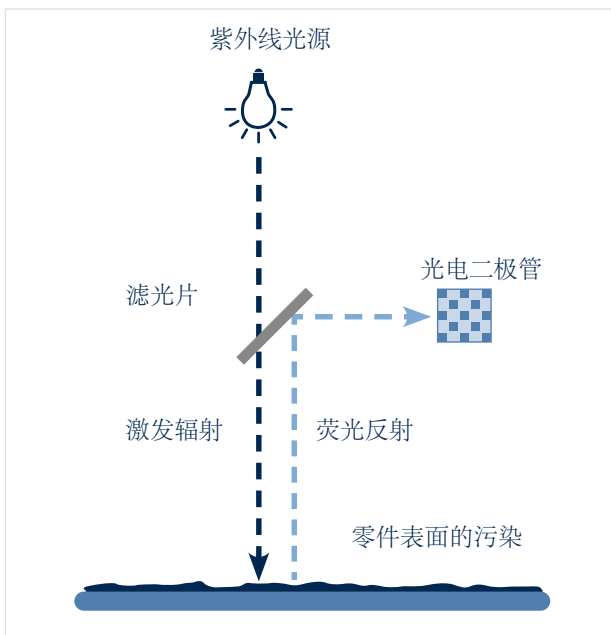
零件表面清洁度检查

应用



- 金属零件加工后的清洁度检查
- 清洁后的产品表面检查
(激光清洗、超细等离子清洗、干冰清洗等)
- 粘合前检查铝压铸件上脱模剂的残留
- 键合前检测键合焊盘上的残留试剂和封装材料
- 剥离隔离材料后对电触点进行表面检查
- 激光焊接前监测金属部件的清洁度
- 医用或真空技术中零件薄膜污染的检查
- 在涂抹防腐油或在粘合剂粘合前涂底漆时，检查膜厚是否足够

荧光测量原理



该测量方法利用有机物质的荧光特性。UV光聚焦在表面上，污染物发出荧光。荧光强度随着污染物层厚度的增加而增加。

相对于SITA荧光标准，强度以RFU（相对荧光单位）表示。

RFU中的测量值越低，表面越清洁。

技术参数

荧光强度模式

测量范围	0...2,000 RFU (相对荧光单位)
最大偏差	测量值的0.5 %
分辨率	0.1 RFU

传感器

激发波长	365 nm, max. 150 mW
检测波长*	460 nm
测量点直径*	D = 1 mm
测量距离*	4.7 mm

* 标准值

清洁度模式

测量范围	0...100 %
分辨率	0.1 %

膜厚模式

测量范围	用户自定义
------	-------

电源

锂电池	3.6 V / 1,950 mAh 工作8小时以上
电源适配器/ USB	100...240 / 5V
功率	2.5 W max.

一般数据

测试应用	> 1,000
测量点数量	每次最多250个点
存储	> 150万个测量值
用户等级	管理员, 操作员
USB	数据传输以及 设备控制
屏幕	LCD光源
尺寸	主机: 129x82x48 mm
(HxWxD)	传感器: 95x50x30 mm
重量 (主机)	530 g

测量设备的管控

用户使用SITA校准探头定期检查和调整, 制造商进行服务和工厂校准

Windows-软件 SITA *SurfaceLog*

- 测量应用的简单生成、管理和导入或导出
- 通过电脑控制测量
- 将引导的测量与零件图纸/图像或测试点关联起来
- 详细的数据可视化、数据筛选、统计评估, 以及通过点状图和箱线图实现的图形展示
- 便捷的报告功能, 用于记录测量结果
- 数据库兼容的Excel和Q-DAS导出
- 支持设备测试与调试以及设备固件更新
- 新增多项用户友好功能, 如扩展评论功能、多语言本地化支持以及用户等级管理系统。

中国代理: 翁开尔 (上海) 国际贸易有限公司

电话: 400-800-0526

网址: www.hjunkel-china.com